

2022

1. Toshio Seki, Hiroki Yamamoto, Kunihiro Koike, Takaaki Aoki and Jiro Matsuo
"High aspect (>20) etching with reactive gas cluster injection"
Japanese Journal of Applied Physics, 2022 年 61 巻 p. SI1007
(doi:10.35848/1347-4065/ac6565)

2021

1. Masaki Hada, Satoshi Ohmura, Tadahiko Ishikawa, Masaki Saigo, Naoya Keio, Wataru Yajima, Tatsuya Suzuki, Daisuke Urushihara, Kou Takubo, Yusuke Masaki, Makoto Kuwahara, Kenji Tsuruta, Yasuhiko Hayashi, Jiro Matsuo, Takayoshi Yokoya, Ken Onda, Fuyuki Shimojo, Muneaki Hase, Sumio Ishihara, Toru Asaka, Nobuyuki Abe, Taka-hisa Arima, Shin-ya Koshihara and Yoichi Okimoto
"Photoinduced oxygen transport in cobalt double-perovskite crystal EuBaCo₂O_{5.39}"
Applied Materials Today, 2021 年 24 巻 101167
(doi:10.1016/j.apmt.2021.101167)
2. 松尾二郎, 瀬木利夫, 青木学窓
"飛躍的な発展を遂げる二次イオン質量分析 (SIMS) 法の展望有機・生体高分子分野への新展開"
表面と真空 特集「実用表面分析の最近の進展」, 2021 年 64 巻 10 号 p. 458-465
(doi:10.1380/vss.64.458)